



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221774210 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 27

(21) 申请号 202323514164.X

(22) 申请日 2023.12.22

(73) 专利权人 无锡市新达共创纳米科技有限公司

地址 214000 江苏省无锡市锡山区锡北镇
八士新坝村八达路18号

(72) 发明人 章倩 章诗岐

(51) Int. Cl.

B24B 29/00 (2006.01)

B24B 27/00 (2006.01)

B24B 41/06 (2012.01)

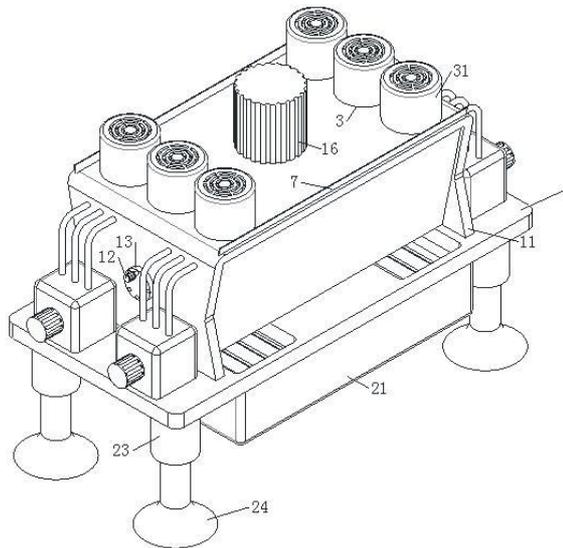
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种用于陶瓷喷涂的抛光装置

(57) 摘要

本实用新型属于抛光技术领域,具体的说是一种用于陶瓷喷涂的抛光装置,包括底板;所述底板顶部设有抛光外壳;所述抛光外壳外侧壁设置有第一旋转台;所述第一旋转台在抛光外壳外侧壁均匀分布;每组所述第一旋转台输出端均连接有第一电推杆;所述第一电推杆与抛光外壳中部为转动配合;所述第一电推杆端部设置有夹板;所述抛光外壳顶部设有第一电机;旋转台的设置可以利用第一电推杆进而调整夹板夹持的陶瓷进行翻转调节,通过第一电机可以转动抛光轮进行抛光打磨,通过第二电推杆可以调节其抛光轮的深度,通过第二旋转台可以使其第二旋转台顶部放置的陶瓷在被抛光轮进行抛光时进行反方向旋转,加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的抛光调节性。



1. 一种用于陶瓷喷涂的抛光装置,包括底板(1);其特征在于:所述底板(1)顶部设有抛光外壳(11);所述抛光外壳(11)外侧壁设置有第一旋转台(13);所述第一旋转台(13)在抛光外壳(11)外侧壁均匀分布;每组所述第一旋转台(13)输出端均连接有第一电推杆(14);所述第一电推杆(14)与抛光外壳(11)中部为转动配合;所述第一电推杆(14)端部设置有夹板(15);所述抛光外壳(11)顶部设有第一电机(16);所述第一电机(16)输出端连接有第二电推杆(17);所述第二电推杆(17)端部设置有抛光轮(18);所述底板(1)顶部设置有第二旋转台(19);所述第一旋转台(13)中部滑动配合有限位杆(12)。

2. 根据权利要求1所述的一种用于陶瓷喷涂的抛光装置,其特征在于:所述底板(1)中部开设有通孔(2);所述通孔(2)在底板(1)中部均匀分布;所述通孔(2)底部设置有收集箱(21);所述收集箱(21)内侧壁设置有过滤板(22);所述收集箱(21)设置在通孔(2)下方;所述底板(1)底部固接有伸缩杆(23);所述伸缩杆(23)在底板(1)底部均匀分布;每组所述伸缩杆(23)底端设置有吸盘(24)。

3. 根据权利要求2所述的一种用于陶瓷喷涂的抛光装置,其特征在于:所述底板(1)顶部设置有通风孔(3);所述通风孔(3)在底板(1)顶部均匀分布;所述通风孔(3)内侧壁固接有防尘罩(31);所述防尘罩(31)内侧壁固接有第二电机(32);所述第二电机(32)输出端连接有连杆(33);所述连杆(33)侧壁固接有扇叶(34);所述扇叶(34)在连杆(33)侧壁均匀分布。

4. 根据权利要求3所述的一种用于陶瓷喷涂的抛光装置,其特征在于:每组所述防尘罩(31)内侧壁设置有百叶片(4);所述百叶片(4)在防尘罩(31)内侧壁均匀分。

5. 根据权利要求4所述的一种用于陶瓷喷涂的抛光装置,其特征在于:所述底板(1)顶部设置有储蓄箱(5);所述储蓄箱(5)在底板(1)顶部均匀分布;每组所述储蓄箱(5)侧壁固接有水泵(51);所述水泵(51)输出端连接有输送管(52);所述输送管(52)从抛光外壳(11)中部穿过。

6. 根据权利要求5所述的一种用于陶瓷喷涂的抛光装置,其特征在于:每组所述输送管(52)端部设有喷头(6);所述喷头(6)中部设置有雾化装置。

一种用于陶瓷喷涂的抛光装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于抛光技术领域,具体的说是一种用于陶瓷喷涂的抛光装置。

背景技术

[0002] 陶瓷喷涂工艺是现在许多表面处理方式之一,属于一种热处理工艺,通过将陶瓷材料以热喷涂形式喷涂在基材表面,形成一层致密、均匀的陶瓷层,因为其加热速度更快,不需要淬火介质,工件变形小,加热层深度和加热轨迹容易控制,能提高工件耐磨性。

[0003] 现有技术中,陶瓷喷涂抛光是一种表面处理技术,常用于修复和美化瓷砖、金属等材料,在对陶瓷喷涂后需要对其进行抛光,达到镜面效果,实现其美观。

[0004] 在长时间使用观察中,发现现有的陶瓷喷涂的抛光装置对于陶瓷抛光的面需要人工转换旋转,延长其抛光时间,降低其抛光效率。

[0005] 为此,本实用新型提供一种用于陶瓷喷涂的抛光装置。

实用新型内容

[0006] 为了弥补现有技术的不足,解决背景技术中提出的至少一个问题,提出的一种用于陶瓷喷涂的抛光装置。

[0007] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:本实用新型所述的一种用于陶瓷喷涂的抛光装置,包括底板;所述底板顶部设有抛光外壳;所述抛光外壳外侧壁设置有第一旋转台;所述第一旋转台在抛光外壳外侧壁均匀分布;每组所述第一旋转台输出端均连接有第一电推杆;所述第一电推杆与抛光外壳中部为转动配合;所述第一电推杆端部设置有夹板;所述抛光外壳顶部设有第一电机;所述第一电机输出端连接有第二电推杆;所述第二电推杆端部设置有抛光轮;所述底板顶部设置有第二旋转台;所述第一旋转台中部滑动配合有限位杆;此步骤通过第一旋转台的设置可以利用第一电推杆进而调整夹板夹持的陶瓷进行翻转调节,通过第一电机可以转动抛光轮进行抛光打磨,通过第二电推杆可以调节其抛光轮的深度,通过第二旋转台可以使其第二旋转台顶部放置的陶瓷在被抛光轮进行抛光时进行反方向旋转,加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的抛光调节性。

[0008] 优选的,所述底板中部开设有通孔;所述通孔在底板中部均匀分布;所述通孔底部设置有收集箱;所述收集箱内侧壁设置有过滤板;所述收集箱设置在通孔下方;所述底板底部固接有伸缩杆;所述伸缩杆在底板底部均匀分布;每组所述伸缩杆底端设置有吸盘;此步骤通过通孔的设置,可以将因抛光轮抛光打磨产生的粉尘将其收集在收集箱内部,通过过滤板对其进行过滤,通过伸缩杆可以调节其底板的高度,通过吸盘可以加强装置的稳定效果,进一步加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的收集性。

[0009] 优选的,所述底板顶部设置有通风孔;所述通风孔在底板顶部均匀分布;所述通风孔内侧壁固接有防尘罩;所述防尘罩内侧壁固接有第二电机;所述第二电机输出端连接有连杆;所述连杆侧壁固接有扇叶;所述扇叶在连杆侧壁均匀分布;此步骤通过通风孔、防尘罩、第二电机、连杆和扇叶的设置可以对抛光残留的粉尘进行清理,进一步加强了用于陶瓷

喷涂的抛光装置的除尘性。

[0010] 优选的,每组所述防尘罩内侧壁设置有百叶片;所述百叶片在防尘罩内侧壁均匀分布;此步骤通过百叶片的设置可以对其空气流动的方向进行控制,进一步加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的控制性。

[0011] 优选的,所述底板顶部设置有储蓄箱;所述储蓄箱在底板顶部均匀分布;每组所述储蓄箱侧壁固接有水泵;所述水泵输出端连接有输送管;所述输送管从抛光外壳中部穿过;此步骤通过储蓄箱、水泵和输送管的设置可以对底板和第二旋转台顶部进行冲洗,减少杂质残留,进一步加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的冲洗性。

[0012] 优选的,每组所述输送管端部设有喷头;所述喷头中部设置有雾化装置;此步骤通过喷头的设置可以使清洁液喷洒更均匀,进一步加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的喷洒效果。

[0013] 本实用新型的有益效果如下:

[0014] 1.本实用新型所述的一种用于陶瓷喷涂的抛光装置,通过第一旋转台的设置可以利用第一电推杆进而调整夹板夹持的陶瓷进行翻转调节,通过第一电机可以转动抛光轮进行抛光打磨,通过第二电推杆可以调节其抛光轮的深度,通过第二旋转台可以使其第二旋转台顶部放置的陶瓷在被抛光轮进行抛光时进行反方向旋转,加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的抛光调节性。

[0015] 2.本实用新型所述的一种用于陶瓷喷涂的抛光装置,通过通孔的设置,可以将因抛光轮抛光打磨产生的粉尘将其收集在收集箱内部,通过过滤板对其进行过滤,通过伸缩杆可以调节其底板的高度,通过吸盘可以加强装置的稳定效果,进一步加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的收集性。

附图说明

[0016] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0017] 图1是本实用新型中的立体图;

[0018] 图2是本实用新型中的夹板结构示意图;

[0019] 图3是本实用新型中的过滤板结构示意图;

[0020] 图4是本实用新型中的百叶片结构示意图;

[0021] 图例说明:

[0022] 1、底板;11、抛光外壳;12、限位杆;13、第一旋转台;14、第一电推杆;15、夹板;16、第一电机;17、第二电推杆;18、抛光轮;19、第二旋转台;2、通孔;21、收集箱;22、过滤板;23、伸缩杆;24、吸盘;3、通风孔;31、防尘罩;32、第二电机;33、连杆;34、扇叶;4、百叶片;5、储蓄箱;51、水泵;52、输送管;6、喷头;7、导流板。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 下面给出具体实施例。

[0025] 如图1至图2所示,本实用新型实施例所述的一种用于陶瓷喷涂的抛光装置,包括底板1;所述底板1顶部设有抛光外壳11;所述抛光外壳11外侧壁设置有第一旋转台13;所述第一旋转台13在抛光外壳11外侧壁均匀分布;每组所述第一旋转台13输出端均连接有第一电推杆14;所述第一电推杆14与抛光外壳11中部为转动配合;所述第一电推杆14端部设置有夹板15;所述抛光外壳11顶部设有第一电机16;所述第一电机16输出端连接有第二电推杆17;所述第二电推杆17端部设置有抛光轮18;所述底板1顶部设置有第二旋转台19;所述第一旋转台13中部滑动配合有限位杆12;工作时,通过第一旋转台13可以利用第一电推杆14进而调整夹板15夹持的陶瓷进行翻转调节,通过第一电机16可以转动抛光轮18进行抛光打磨,通过第二电推杆17可以调节其抛光轮18的深度,通过第二旋转台19可以使其第二旋转台19顶部放置的陶瓷在被抛光轮18进行抛光时进行反方向旋转,通过限位杆12可以对旋转的第一旋转台13进行限位固定;此步骤通过第一旋转台13的设置可以利用第一电推杆14进而调整夹板15夹持的陶瓷进行翻转调节,通过第一电机16可以转动抛光轮18进行抛光打磨,通过第二电推杆17可以调节其抛光轮18的深度,通过第二旋转台19可以使其第二旋转台19顶部放置的陶瓷在被抛光轮18进行抛光时进行反方向旋转,加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的抛光调节性。

[0026] 进一步的,如图1至图3所示,所述底板1中部开设有通孔2;所述通孔2在底板1中部均匀分布;所述通孔2底部设置有收集箱21;所述收集箱21内侧壁设置有过滤板22;所述收集箱21设置在通孔2下方;所述底板1底部固接有伸缩杆23;所述伸缩杆23在底板1底部均匀分布;每组所述伸缩杆23底端设置有吸盘24;工作时,通过通孔2可以将因抛光轮18抛光打磨产生的粉尘将其收集在收集箱21内部,通过过滤板22对其进行过滤,通过伸缩杆23可以调节其底板1的高度,通过吸盘24可以加强装置的稳定效果;此步骤通过通孔2的设置,可以将因抛光轮18抛光打磨产生的粉尘将其收集在收集箱21内部,通过过滤板22对其进行过滤,通过伸缩杆23可以调节其底板1的高度,通过吸盘24可以加强装置的稳定效果,进一步加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的收集性。

[0027] 进一步的,如图1至图4所示,所述底板1顶部设置有通风孔3;所述通风孔3在底板1顶部均匀分布;所述通风孔3内侧壁固接有防尘罩31;所述防尘罩31内侧壁固接有第二电机32;所述第二电机32输出端连接有连杆33;所述连杆33侧壁固接有扇叶34;所述扇叶34在连杆33侧壁均匀分布;工作时,通过第二电机32驱动连杆33带动扇叶34产生空气流动,对底板1顶部打磨残留的粉尘进行清理,通过防尘罩31可以减少外界杂质进入到空气流动中;此步骤通过通风孔3、防尘罩31、第二电机32、连杆33和扇叶34的设置可以对抛光残留的粉尘进行清理,进一步加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的除尘性。

[0028] 进一步的,如图4所示,每组所述防尘罩31内侧壁设置有百叶片4;所述百叶片4在防尘罩31内侧壁均匀分布;工作时,通过防尘罩31内侧壁均匀分布的百叶片4可以对扇叶34产生的空气流动;此步骤通过百叶片4的设置可以对其空气流动的方向进行控制,进一步加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的控制性。

[0029] 进一步的,如图1至图2所示,所述底板1顶部设置有储蓄箱5;所述储蓄箱5在底板1顶部均匀分布;每组所述储蓄箱5侧壁固接有水泵51;所述水泵51输出端连接有输送管52;所述输送管52从抛光外壳11中部穿过;工作时,通过水泵51驱动储蓄箱5内部的清洁液对静

置的装置进行冲洗,减少底板1和第二旋转台19顶部的杂质残留;此步骤通过储蓄箱5、水泵51和输送管52的设置可以对底板1和第二旋转台19顶部进行冲洗,减少杂质残留,进一步加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的冲洗性。

[0030] 进一步的,如图1至图2所示,每组所述输送管52端部设有喷头6;所述喷头6中部设置有雾化装置;工作时,通过喷头6和雾化装置可以使清洁液喷洒更均匀,加强清洁液的喷洒效果;此步骤通过喷头6的设置可以使清洁液喷洒更均匀,进一步加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的喷洒效果。

[0031] 进一步的,如图1所示,所述抛光外壳11中部滑动配合有导流板7;工作时,通过导流板7可以对抛光产生的粉尘进行阻挡,使其不会飘散出来并将其引导进收集箱21内部;此步骤通过导流板7的设置可以对抛光产生的粉尘进行阻挡和引导,进一步加强了用于陶瓷喷涂的抛光装置的引导效果。

[0032] 工作原理:工作时,通过第一旋转台13可以利用第一电推杆14进而调整夹板15夹持的陶瓷进行翻转调节,通过第一电机16可以转动抛光轮18进行抛光打磨,通过第二电推杆17可以调节其抛光轮18的深度,通过第二旋转台19可以使其第二旋转台19顶部放置的陶瓷在被抛光轮18进行抛光时进行反方向旋转,通过限位杆12可以对旋转的第一旋转台13进行限位固定,通过通孔2可以将因抛光轮18抛光打磨产生的粉尘将其收集在收集箱21内部,通过过滤板22对其进行过滤,通过伸缩杆23可以调节其底板1的高度,通过吸盘24可以加强装置的稳定效果,通过第二电机32驱动连杆33带动扇叶34产生空气流动,对底板1顶部打磨残留的粉尘进行清理,通过防尘罩31可以减少外界杂质进入到空气流动中,通过防尘罩31内侧壁均匀分布的百叶片4可以对扇叶34产生的空气流动,通过水泵51驱动储蓄箱5内部的清洁液对静置的装置进行冲洗,减少底板1和第二旋转台19顶部的杂质残留,通过喷头6和雾化装置可以使清洁液喷洒更均匀,加强清洁液的喷洒效果。

[0033] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

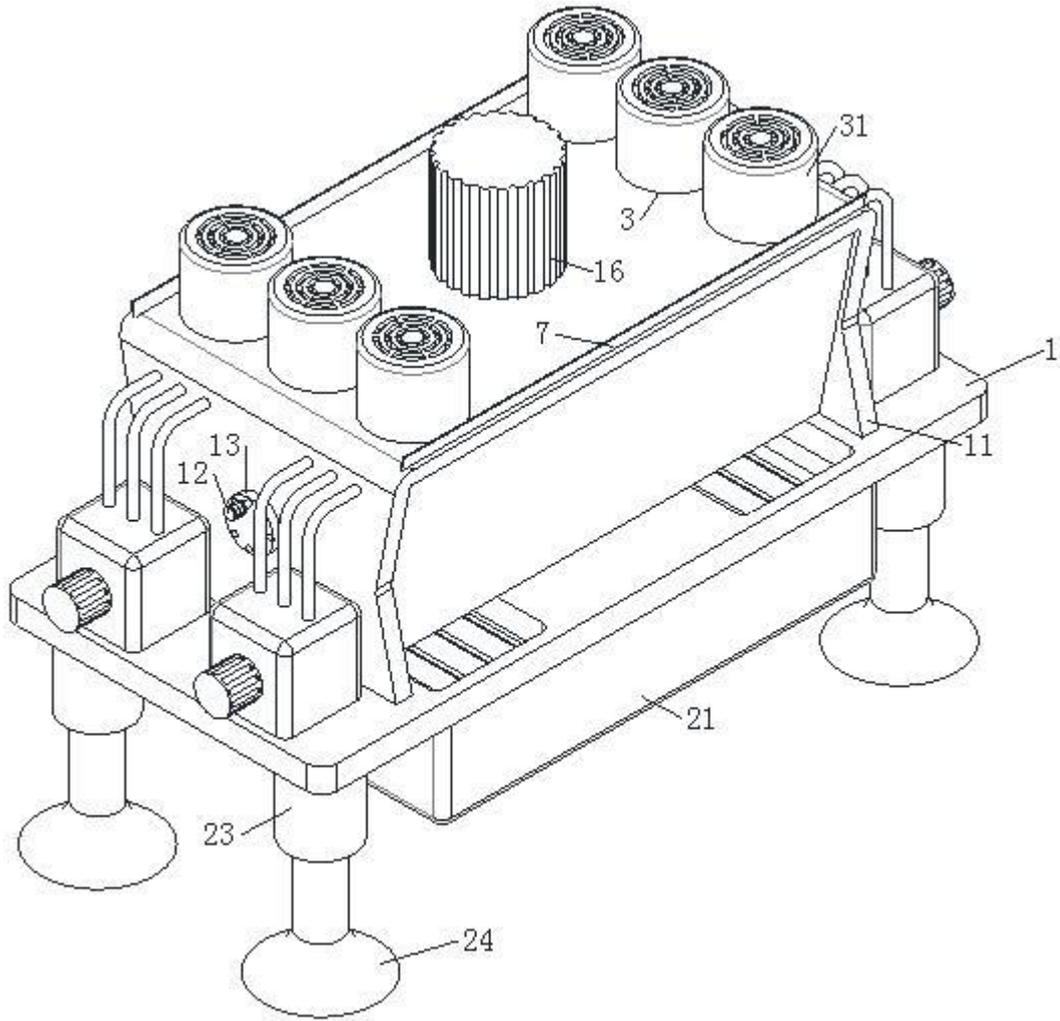


图 1

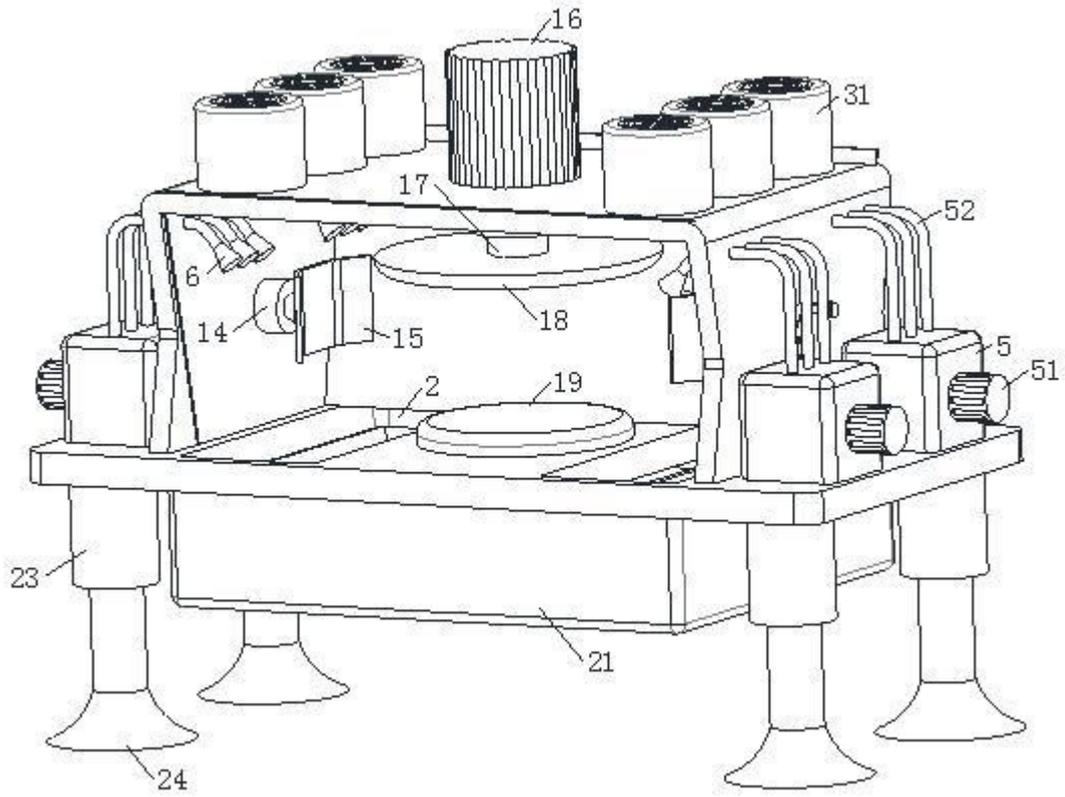


图 2

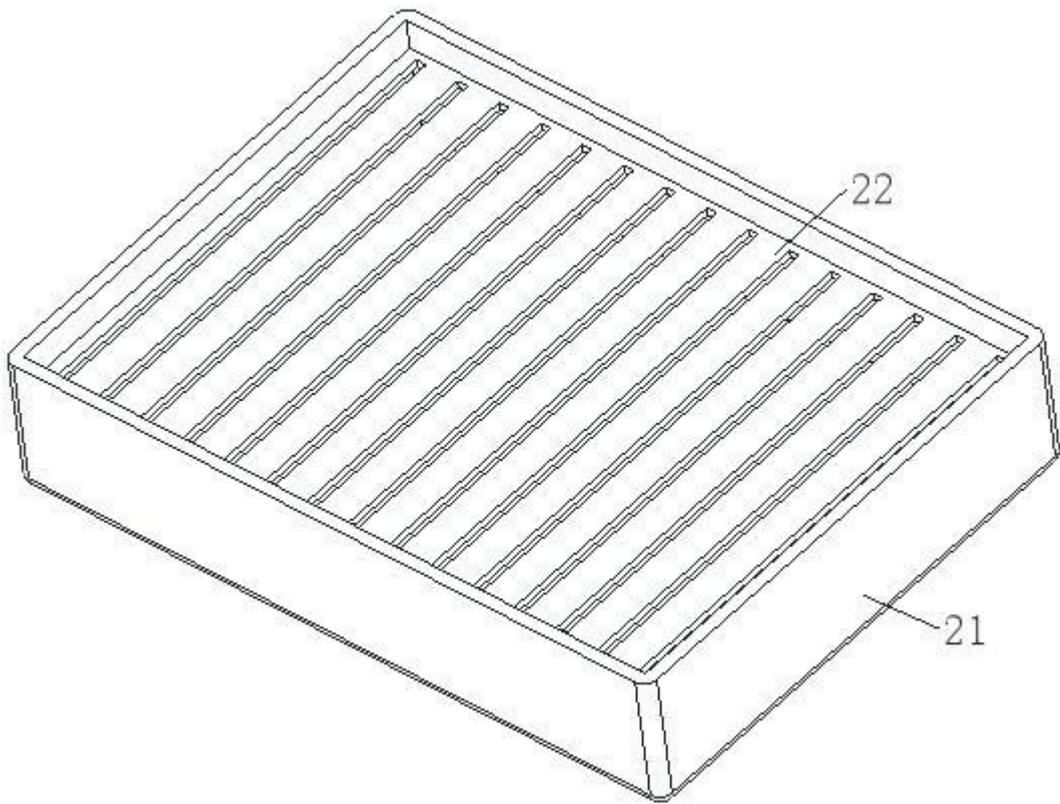


图 3

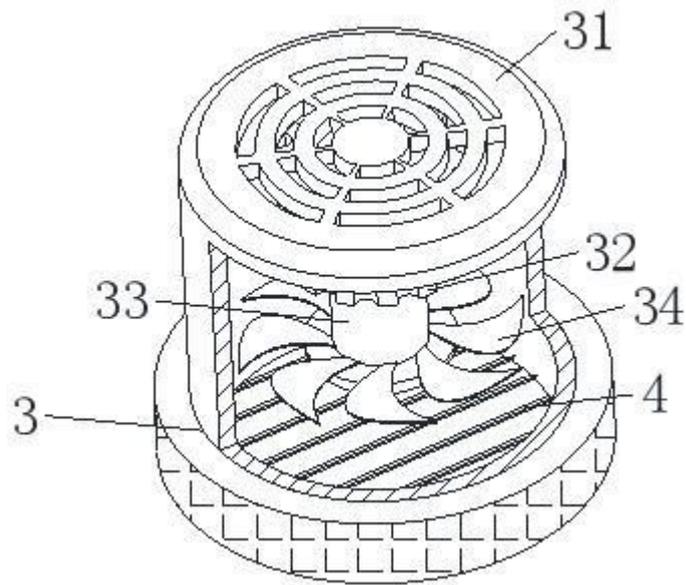


图 4